



ФИНАНСИРАНО ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
NextGenerationEU



РУСЕНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ



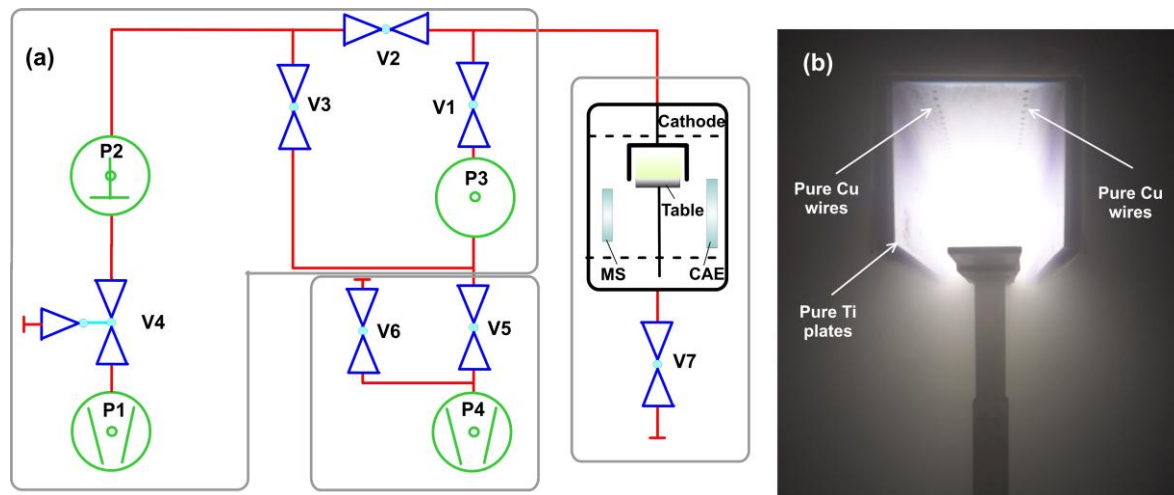
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И УСТОЙЧИВОСТ

Отлагане на PVD покрития

- Проф. дн Мария Николова, д-р
- mpnikolova@uni-ruse.bg
- Кат. Материалознание и технология на материалите

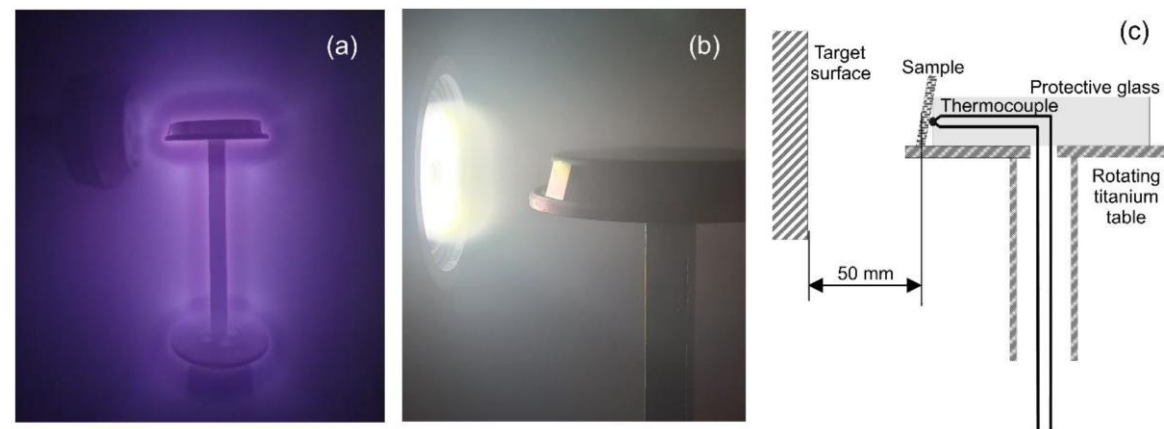


Получаване на тънки филми



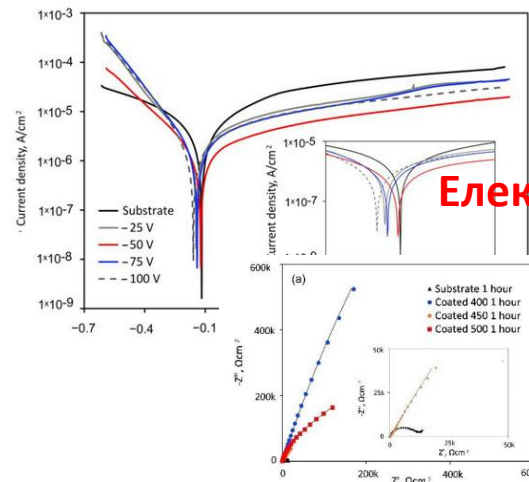
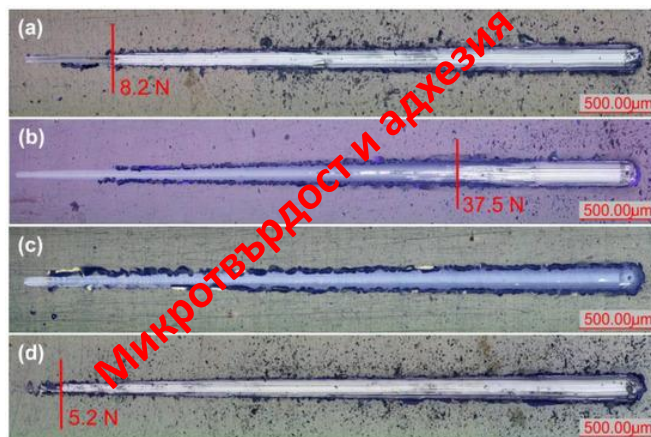
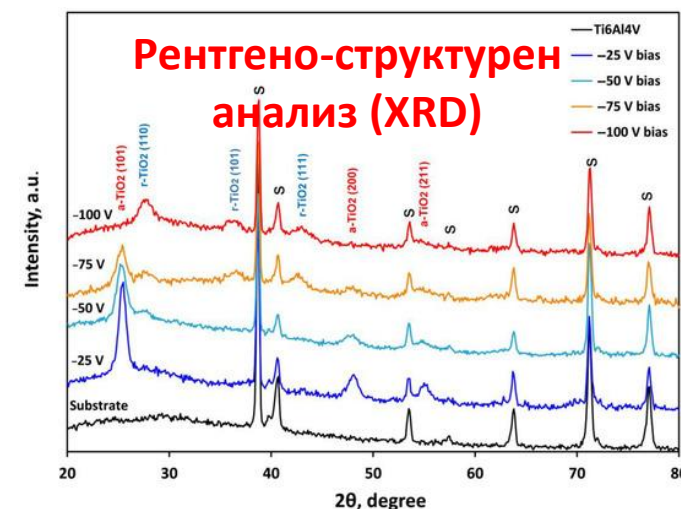
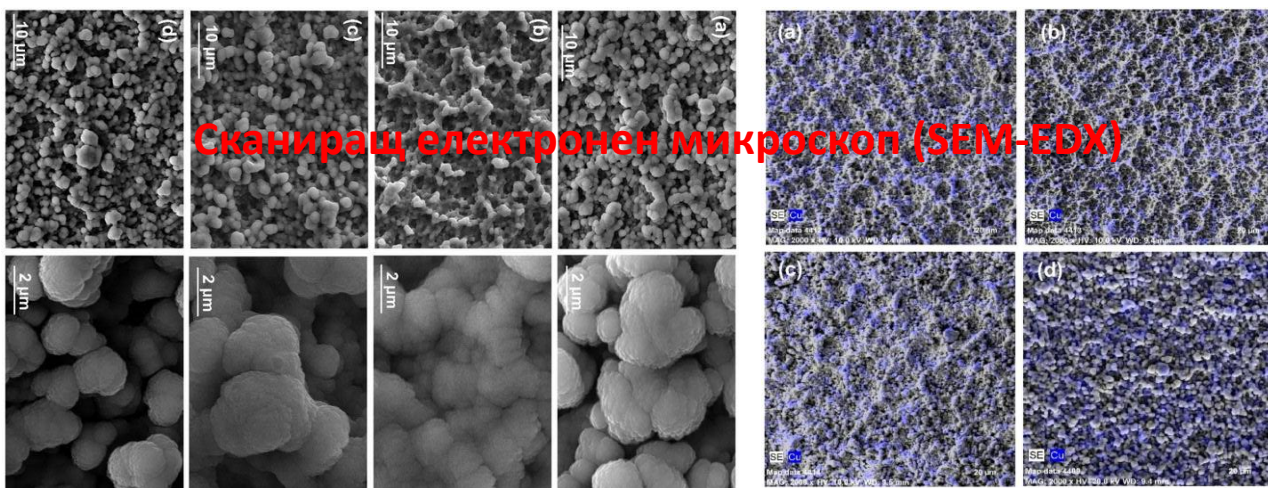
Фигура 1. Схема на инсталацията (а) с нейната вакуумна помпена система: P1 и P4 – форвакуумна помпа, P2 - бустерна двуроторна вакуумна помпа, P3 – дифузионна помпа, V1÷V7 – вакуумни вентили (шибри); б) снимка на работещата система с тлеещ разряд

Фигура 2. Изображения на почистване с тлеещ разряд (а) DC магнетронно разпрашване (MS) на оксидни покрития от Ti-Cu мишена (b) и схематичен изглед на експерименталната система с термодвойка (c).





Характеризиране на тънки филми



Електрохимични изследвания

